

財團法人國家實驗研究院 公告

發文日期：中華民國115年7月13日
發文字號：國研授半導體蝕字第1151300952號
附件：附件一

主旨：本院台灣半導體研究中心（以下簡稱本中心）8吋電子束蒸鍍系統移入作業通知

公告事項：

- 一、配合8吋電子束蒸鍍系統移入3F 10K級無塵室作業，相關搬運時間、動線與作業範圍公告如下：
- 二、作業時間：115年7月 21 日（星期二）09:30 至 17:00。
- 三、作業內容：進行8吋電子束蒸鍍系統移入3F 10K級無塵室作業，作業動線範圍內之人員請注意自身安全，非必要請勿靠近搬遷動線。（搬運動線位置請參閱附件一。）
- 四、注意事項：若搬運作業時間有任何變動，將另行公告通知。
- 五、聯絡資訊：若對機台移入作業有任何疑問，請洽負責工程師：許文達 分機：7537 電子郵件：alan@nlar.org.tw

院長 蔡長隆
授權單位主管決行